

光学干渉式リアルタイム膜厚モニター

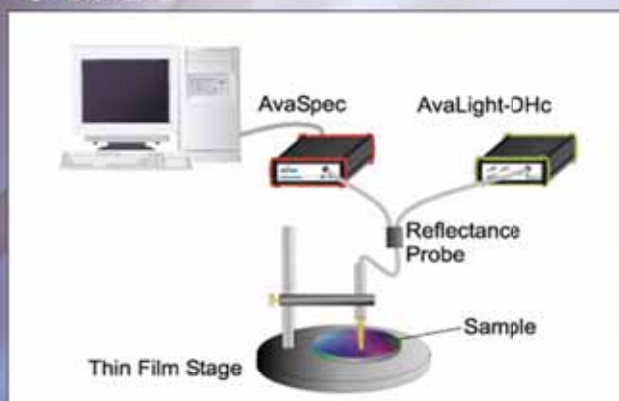
膜厚測定

基板と膜からの干渉で膜厚を簡単に計算で求めます。

- 単相膜の場合、材料のn値及びk値がデータベースから選択
- 未知の場合は別装置で測定した値を利用可能

◆ 測定対象：Si/SiO₂ 膜、レジスト、酸化膜、窒化膜、ポリイミド、PET膜等

◆ 模式図



◆ 測定例 (Si/SiO₂ 膜 817 nm)



◆ 構成例

分光器	AvaSpec-VARIUS-2K Grating UA (200 nm~1100 nm) , 100 μm slit, DUV coating, OSC-UA
膜厚測定範囲	10 nm~50 μm
ソフトウェア	AvaSoft-Thinfilm, TFT mode, March Specrum mode
光源	AvaLight-DHc (小型 重水素-ハロゲン光源) AvaLight-DH-S (high Power DH 光源) AvaLight-HAL-S-Mini (小型high Power ハロゲン光源)
光ファイバー	反射プローブ : FCR-7UV200/400-ME, UV/VIS, 2m, SMA